

VERBALE SEDUTA RISERVATA VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA **FORNITURA, CONSEGNA, POSA IN OPERA, MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE DI UN MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE CON SORGENTE AD EMISSIONE DI CAMPO (FIELD EMISSION SCANNING ELECTRON MICROSCOPE, FE-SEM)** – RDO N. 1930422 - CIG N. 7409897870

L'anno duemiladiciotto, il giorno 15 del mese di giugno alle ore 11:13 in Roma, nella Sala Riunioni al primo piano della sede del Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente (ex palazzina Chimica applicata ed. RM038) dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Via Eudossiana 18, si sono riuniti i seguenti componenti della Commissione giudicatrice,:

-Dott. Andrea Putignani, Direttore dell'Area Affari Istituzionali di questo Ateneo, nella qualità di Presidente;

-Ing. Andrea Brotzu, Cat. D4 – Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente, nella qualità di membro;

-Dott. Simone Chicarella, Cat. D1, – Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente, nella qualità di membro.

La Commissione procede ad applicare la formula prevista al punto 16.3. del disciplinare di gara per l'attribuzione del punteggio all'offerta economica. Il punteggio risulta pari a 25.

Alle ore 11:17 la Commissione conclude i lavori e chiude la seduta riservata.

Il presente verbale, composto di 2 pagine, è approvato all'unanimità e sottoscritto dalla Commissione seduta stante.

IL PRESIDENTE

Dott. Andrea Putignani _____

I MEMBRI

Ing. Andrea Brotzu _____

Dott. Simone Chicarella _____

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELL'UFFICIO

Documento privo di firma perché gestito in formato digitale

art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/1993 – G.U. n. 42 del 20/02/1993